

ナノプローブテクノロジー 第167委員 第74回研究会 予定内容

「ナノスケール形状・形態計測の最先端」

日時：2014年4月24日（木）

場所：産業技術総合研究所 臨海副都心センター 別館11階会議室 11205室

プログラム：

13:00～13:05 委員長挨拶 大西 洋

13:05～13:15 委員総会 大西 洋

13:15～13:50 CD-SEMを中心とした先端デバイス形状計測技術 日立製作所 田中 麻紀

13:50～14:25 STEMによる半導体構造の形状測定 東京大学工学系研究科 高増 潔

14:25～15:00 Advances in 3DAFM Technology & Introduction to Peak Force Tapping for advanced semiconductor applications. Bruker Nano Adam Feinstein

休憩：15:00～15:15

15:15～15:50 3D AFM Method for Sidewall Roughness Characterization

- Effect of Aerial Image Contrast on Resist Sidewall -

Park Systems Corp. Ryan (Young K.) Yoo, Ph.D

15:50～16:25 微粒子・ナノ粒子測定の新たな挑戦 島津製作所 島岡 治夫

16:25～16:50 ナノスケール標準試料のロードマップ 計測標準研究部門 権太 聡

16:50～17:00 白色干渉計とAFMの複合装置（新製品紹介） 日立ハイテクサイエンス

SPMとそれを補う依頼分析技術の紹介

17:00～17:10 材料科学技術振興財団

17:00～17:20 コベルコ科研

17:20～17:30 住化分析センター

17:45～19:30 表彰式/懇親会

会場：臨海副都心センター 別館11階ラウンジ

企画委員

産業技術総合研究所 井藤 浩志

(株)日立製作所 渡辺 正浩

物質材料研究機構 藤田 大介

東北大学 中嶋 健